

©1994 г.

## ЭФФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ $\text{Ni}-\text{TiO}_2-\text{p-Si}$

*А.П.Болтаев, Т.М.Бурбаев, Г.А.Калюжная, В.А.Курбатов, Н.А.Пенин*

Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук,  
117924, Москва, Россия  
(Получена 18 февраля 1994 г. Принята к печати 24 февраля 1994 г.)

Наблюдался эффект отрицательной емкости в гетероструктурах  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-\text{p-Si}$ . Эффект отрицательной емкости обнаружен в гетероструктурах при отрицательном напряжении на никелевом контакте и связан с уменьшением величины заряда при увеличении напряжения на контакте в барьере Шоттки. Уменьшение величины заряда в барьере обусловлено туннелированием электронов из никелевого контакта на пустые, положительно заряженные доноры в окиси титана и нейтрализацией этих доноров. Величина отрицательной емкости прямо пропорциональна потоку электронов на донорные уровни. Вычисленные значения отрицательной емкости хорошо согласуются с измеренными значениями емкости.

Эффект отрицательной емкости (ОЕ) наблюдался на прямо смещенных барьерах Шоттки, изготовленных из различных материалов ( $\text{NiSi}-n\text{-Si}$ ,  $\text{WNi}-n\text{-GaAs}$ ,  $\text{Pd}-n\text{-GaAs}$ ,  $\text{Pd}-n\text{-Si}$ ), в ряде работ [1–3]. Внимание к явлению ОЕ обусловлено не только чисто научными интересами. Существуют определенные практические причины, поскольку ОЕ в цепи переменного тока ведет себя подобно индуктивности. В то же время технологический процесс создания образцов с ОЕ полностью вписывается в планарно-групповой процесс создания интегральных схем. Если учесть, что до настоящего времени не разработан элемент индуктивности, технологический процесс изготовления которого совпадал бы с технологическим процессом изготовления интегральных схем, то интерес разработчиков ИС к ОЕ становится понятным. Следует также заметить, что до настоящего времени механизм образования ОЕ в полупроводниковых структурах до конца не выяснен. Это явление связывают с инжекцией неосновных носителей заряда в объемный полупроводник с электродом, расположенного с противоположной стороны барьера Шоттки [1], либо с уменьшением поверхностного заряда занятых поверхностных состояний, находящихся ниже уровня Ферми, за счет ударной ионизации свободными электронами, преодолевшими барьер Шоттки [2].

Нами наблюдался эффект ОЕ в гетероструктурах  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-\text{p-Si}$ . Изучению этого эффекта и посвящена настоящая статья.

## Эксперимент

Исследование эффекта ОЕ в гетероструктурах  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-p-\text{Si}$  проводилось на установке, блок-схема которой представлена на рис. 1. На пилообразное напряжение с периодом  $10^3$  с и амплитудой до 10 В накладывалось синусоидальное напряжение с частотой от 20 Гц до 100 кГц и амплитудой до 50 мВ. Суммарное напряжение подавалось на гетероструктуру. Величина сигнала снималась с нагрузочного сопротивления  $R_n$ . На установке измерялись вольт-амперные, вольт-фарадные характеристики и проводимость. Установка позволяла измерять токи постоянного напряжения от  $10^{-11}$  А при сопротивлении нагрузки  $R_n=100$  кОм. Минимальная измеряемая емкость равнялась  $\sim 0.1$  пФ. Проводимость можно было измерять в пределах от  $2 \cdot 10^{-3}$  См до  $10^{-7}$  См. Калибровка установки осуществлялась с помощью эталонных сопротивлений и емкостей. Погрешность измерений не превышала 5%.

Измерения проводились на образцах гетероструктур, изготовленных на подложках кремния  $p$ -типа с удельным сопротивлением  $\rho = 1$  Ом·см. Слой окиси титана толщиной (0.04–0.1) мкм наносился золь-гель-методом [4] с последующей сушкой ( $T \approx 450^\circ\text{C}$ ). Электрический контакт к гетероструктуре осуществлялся через слой никеля, нанесенного на слой окиси титана методом термовакуумного распыления. Диаметр электрического контакта составлял 1 мм.

Измеренные вольт-амперные характеристики образцов и зависимости проводимости и емкости от величины внешнего напряжения представлены на рис. 2, 3. Знак внешнего напряжения соответствует полярности напряжения на никелевом контакте. Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) и зависимостей проводимости и емкости образцов проводились при комнатной температуре.

## Обсуждение

Феноменологически очевидно, что эффект ОЕ структуры  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-p-\text{Si}$  обусловлен уменьшением величины заряда на обкладках конденсатора при увеличении электрического напряжения на обкладках. Для выяснения механизма этого явления необходимо изучить процессы накопления и изменения заряда на барьерах в структуре  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-p-\text{Si}$ , вызванные изменением электрического поля.

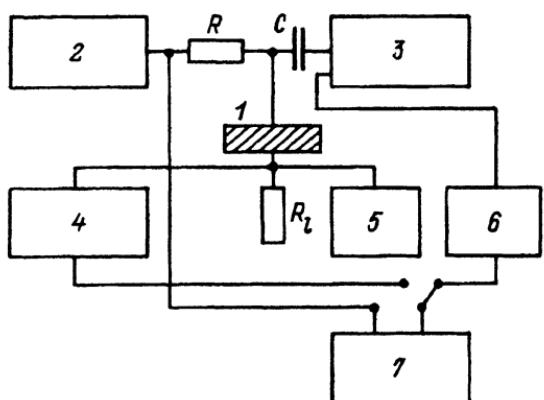


Рис. 1. Блок-схема установки для измерения вольт-фарадной характеристики.

- 1 — образец,
- 2 — генератор пилообразного напряжения,
- 3 — генератор синусоидальных колебаний,
- 4 — вольтметр постоянного тока,
- 5 — селективный вольтметр,
- 6 — фазовый детектор,
- 7 — графопостроитель.

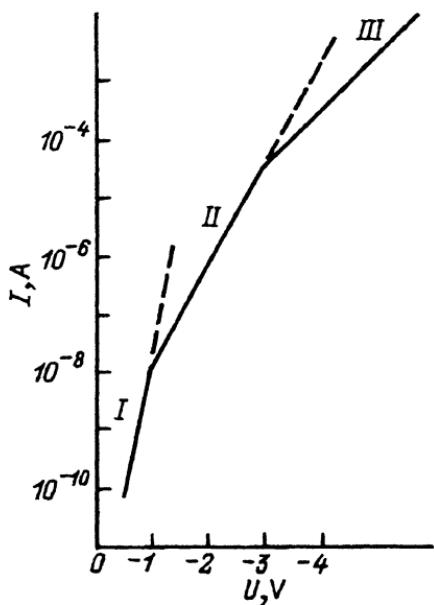


Рис. 2. Вольт-амперная характеристика гетероструктуры.

Энергетическая зонная диаграмма структуры представлена на рис. 4. При построении зонной диаграммы мы учитывали, что ширина запрещенной зоны окиси титана  $E_{\text{TiO}_2} = 3.05 \text{ эВ}$  [5], а кремния  $E_{\text{Si}} = 1.12 \text{ эВ}$  [6]; электронное сродство  $\chi_{\text{TiO}_2} = 3.8 \text{ эВ}$  [5],  $\chi_{\text{Si}} = 4 \text{ эВ}$  [6]; работа выхода никеля  $A = 5.2 \text{ эВ}$  [6]. Из величины омического сопротивления слоя окиси титана  $R_T \approx 2 \text{ кОм}$ , которая может быть найдена из зависимости проводимости от внешнего поля, при толщине слоя  $0.04 \text{ мкм}$ , площади  $S = 8 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2$  и подвижности электронов в окиси титана  $\mu \approx 1 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$  [5] с использованием выражения  $\rho = 1/en\mu$  определялась концентрация свободных носителей заряда в окиси титана ( $n = 10^{12} \text{ см}^{-3}$ ). Зная концентрацию электронов в окиси титана, можно определить положение уровня Ферми ( $E_{c\text{TiO}_2} - E_F = 0.4 \text{ эВ}$ ). Концен-

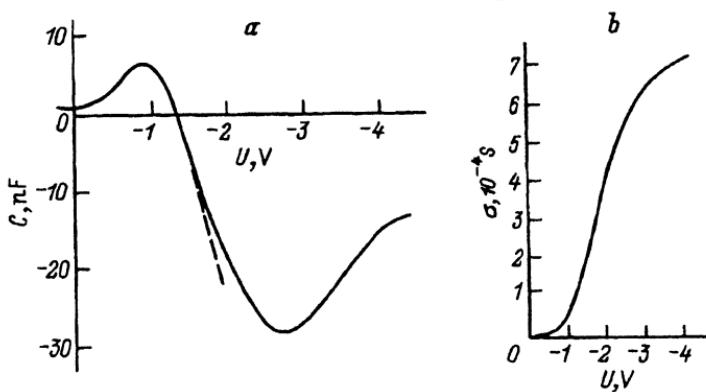


Рис. 3. Зависимости емкости (а) и проводимости (б) гетероструктуры от величины внешнего напряжения.

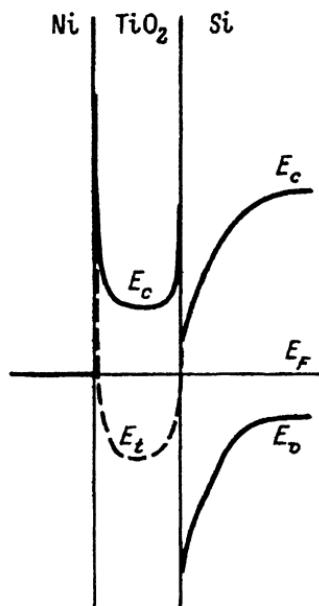


Рис. 4. Энергетическая зонная диаграмма гетероструктуры.

трация свободных носителей заряда в зоне проводимости окиси титана, очевидно, связана с наличием донорных примесей в слое  $\text{TiO}_2$ . Концентрация донорных примесей составляет  $10^{19} - 10^{20} \text{ см}^{-3}$ , о чем свидетельствует высокий фактор неидеальности ВАХ, обусловленный туннельным эффектом, который равен 4–6. Энергия ионизации таких доноров с концентрацией  $N_t = (10^{19} - 10^{20}) \text{ см}^{-3}$ , чтобы обеспечить концентрацию свободных носителей в зоне проводимости на уровне  $n = 10^{12} \text{ см}^{-3}$ , должна быть  $E_t = (0.8 - 0.86) \text{ эВ}$ , что отражено на зонной диаграмме. Донорные уровни в слое окиси титана, по-видимому, связаны с вакансиями кислорода [5]. Положение уровня Ферми для кремния  $p$ -типа с концентрацией свободных носителей заряда  $p = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  равно  $E_F - E_v = 0.2 \text{ эВ}$ .

На зонной диаграмме структуры мы видим два перехода. Барьер Шоттки, образованный никелевым контактом и слоем окиси титана, и гетеропереход  $\text{TiO}_2-p\text{-Si}$ . Для того чтобы понять, какой из двух переходов, барьер Шоттки или гетеропереход, обладает эффектом отрицательной емкости, рассмотрим механизм протекания тока через барьера и процессы изменения заряда в области пространственных зарядов двух переходов. При отрицательном напряжении на никелевом контакте гетеропереход смешен в прямом направлении. Электроны из слоя окиси титана, преодолев барьер гетероперехода, поступают в кремний. Анализ механизмов прохождения электронами гетероперехода показывает, что с ростом прямого напряжения на гетеропереходе величина заряда в области пространственного заряда гетероперехода увеличивается. Емкость гетероперехода с изменением прямого смещения на нем остается положительной.

Емкость обратно смещенного барьера Шоттки, по-видимому, определяется, с одной стороны, увеличением положительного заряда благодаря увеличению ширине обедненной области перехода с ростом

обратного электрического напряжения, а с другой — уменьшением положительного заряда перехода из-за потока электронов из никелевого контакта в слой окиси титана. Возможны 3 механизма протекания тока через барьер  $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ :

1. Термоэмиссионный: электроны при переходе из никеля в окись титана преодолевают барьер, высота которого больше 1 эВ (рис. 4).

2. Туннельный: электроны из никеля переходят в зону проводимости окиси титана, туннелируя через барьер, высота которого  $U_b \approx 1.2 \text{ эВ}$ , а ширина  $d_t \approx 100 \text{ \AA}$ . Туннелировать в зону проводимости окиси титана способны лишь те электроны, энергия которых на 0.4 эВ больше энергии уровня Ферми никеля.

3. Туннелирование через примесные уровни с последующей генерацией: электроны из никеля с энергиями меньше или равной энергии уровня Ферми туннелируют на свободные донорные центры. С донорных уровней электроны переходят в зону проводимости слоя окиси титана благодаря тепловой эмиссии.

Очевидно, что наиболее вероятный механизм переноса электронов в барьере Шоттки в структуре  $\text{Ni}-\text{TiO}_2-p\text{-Si}$  при внешних напряжениях до 1 В связан с туннелированием электронов на пустые донорные уровни с последующей их эмиссией в зону проводимости окиси титана. На это указывает вид экспериментальной ВАХ (рис. 2), которую можно представить формулой

$$I = I_0 \exp(AU), \quad (1)$$

где  $I_0 = 2.3 \cdot 10^{-11} \text{ А}$  — ток насыщения, полученный экстраполяцией линейного в логарифмическом масштабе участка ВАХ к точке  $U = 0$ ;  $A = 8 \text{ В}^{-1}$  — постоянная для данного образца. При таком значении  $A$ , которое примерно в 5 раз меньше величины  $e/kT$  ( $T = 300 \text{ К}$ ), и экспоненциальном характере протекания тока ВАХ, как правило, определяется туннелированием электронов сквозь барьер при участии приповерхностных примесных уровней [7]. В этом случае, с одной стороны, электроны, туннелирующие из контакта на донорные, положительно заряженные уровни, нейтрализуют их и уменьшают общий положительный заряд области пространственного заряда барьера Шоттки. С другой стороны, термическая эмиссия электронов с донорных уровней в зону проводимости и их уход от границы благодаря приграничному потенциальному приводят к увеличению положительных зарядов в области пространственного заряда барьера. В стационарном состоянии число электронов, поступающих за счет туннелирования на положительно заряженные донорные уровни, должно равняться числу электронов, перешедших с донорных уровней в зону проводимости благодаря термической эмиссии ( $G$ ), и равняться потоку электронов из никелевого контакта в окись титана ( $I/e$ ):

$$G = I/e. \quad (2)$$

Темп генерации электронов с донорного уровня в зону проводимости  $G$  в области пространственного заряда определяется выражением [8]

$$G = v_t \sigma_n N_t n_1 f V, \quad (3)$$

где  $v_t$  — тепловая скорость электронов,  $\sigma_n$  — сечение захвата электрона на примесный уровень,  $N_t$  — концентрация доноров в окиси титана,

$n_1$  — концентрация электронов в зоне проводимости при совпадении уровня Ферми с донорным уровнем,  $V = Sd_t$  — объем области пространственного заряда барьера Шоттки,  $d_t$  — ширина области пространственного заряда в окиси титана,  $f$  — вероятность заполнения донорных состояний электронами. Учитывая выражения (1)–(3), получим

$$f = I_0 \exp(AU)/ev_t\sigma_n N_t n_1 V. \quad (4)$$

Из уравнения (4) видно, что вероятность заполнения донорных уровней с ростом внешнего напряжения увеличивается. Следовательно, концентрация ионизованных доноров  $N_t(1-f)$  и величина заряда  $Q$  области пространственного заряда с ростом внешнего электрического поля уменьшаются:

$$Q = eN_t V(1-f). \quad (5)$$

Очевидно, вследствие этого емкость пространственного заряда барьера Шоттки, обусловленная туннельным переходом электронов на донорные уровни, будет отрицательной:

$$C_t = dQ/dU = -AI/v_t\sigma_n n_1. \quad (6)$$

Суммарная емкость барьера Шоттки будет складываться из положительной емкости области пространственного заряда  $C_b$  и отрицательной емкости ( $C = C_t + C_b$ ).

При незначительных токах через структуру ее емкость практически определяется емкостью обратно смешенного барьера Шоттки. С ростом тока через структуру растет отрицательная емкость туннельного тока, а суммарная емкость барьера Шоттки уменьшается. Этот эффект можно наблюдать на рис. 3. При внешнем напряжении больше 1 В отрицательная емкость становится преобладающей. Рассчитанная по формуле (6) емкость барьера при  $\sigma_n \approx 10^{-14} \text{ см}^{-2}$  практически совпадает с измеренными значениями емкости структуры в области внешних напряжений от -1.3 до -2.5 В.

При напряжениях на структуре от -2.5 В и выше наблюдается уменьшение отрицательной емкости структуры. Этот эффект мы связываем с уменьшением доли туннельного тока на примесные уровни в окиси титана по сравнению с током электронов из никелевого контакта. С другой стороны, с увеличением прямого напряжения на гетеропереходе увеличивается положительная емкость гетероперехода, что так же приводит к соответствующему изменению суммарной емкости структуры.

### Заключение

Эффект отрицательной емкости, обнаруженный в гетероструктурах Ni-TiO<sub>2</sub>-p-Si при отрицательном напряжении на никелевом контакте, связан с уменьшением величины заряда при увеличении напряжения на контакте в барьере Шоттки. Уменьшение величины заряда в барьере обусловлено туннелированием электронов из никелевого контакта на пустые, положительно заряженные доноры в окиси титана, инейтрализацией этих доноров. Величина отрицательной емкости прямо пропорциональна потоку электронов на донорные уровни. Вычисленные значения отрицательной емкости хорошо согласуются с измеренными значениями емкости.

## Список литературы

- [1] J. Werner, A.F. Levi, R.T. Tung, M. Anzlowar, M. Pinto. Phys. Rev. Lett., **60**, 53 (1988).
- [2] X. Wu, E.S. Yang, H.L. Evans. J. Appl. Phys., **68**, 2845 (1990).
- [3] K. Steiner, N. Uchitomii, N.J. Toyoda. Vac. Sci. Techn. B, **8**, 1113 (1990).
- [4] D.E. Yoldas. Appl. Opt., **21**, 960 (1982).
- [5] В.Б. Лазарев, В.В. Соболев, И.С. Шэплыгин. Химические и физические свойства простых оксидов металлов (М., Наука, 1983).
- [6] С. Зи. Физика полупроводниковых приборов (М., Мир, 1984).
- [7] А. Милнес, Д. Фойхт. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник (М., Мир, 1975).
- [8] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников (М., Наука, 1977).

Редактор В.В. Чалдышев

## The Effect of Negative Capacitance in the Ni-TiO<sub>2</sub>-p-Si Heterojunction

A.P. Boltaev, T.M. Burbaev, G.A. Kaljuzhnaja, V.A. Kurbatov and N.A. Penin

P.N. Lebedev Physics Institute, Russian Academy of Science, 117924, Moscow, Russia

A negative capacitance effect has been observed in the Ni-TiO<sub>2</sub>-p-Si heterojunction at negative bias on the nickel contact. This phenomenon is explained by a decrease of charge with increasing the heterojunction current. The decrease of charge is caused by tunneling of electrons towards the empty donor states in TiO<sub>2</sub> with neutralization of these states. The results of calculations are in good agreement with the experimental data.

---